# Фотоемкостной эффект в монополярном металл–диэлектрик–полупроводник конденсаторе при низких температурах

#### © Н.А. Пенин

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 117924 Москва, Россия

(Получена 13 октября 1999 г. Принята к печати 16 ноября 1999 г.)

Теоретически исследован фотоемкостной эффект в монополярном МДП конденсаторе при оптической ионизации примесных атомов в полупроводниковом электроде при низких температурах. Выведены аналитические выражения для характеристик емкость-напряжение и фотоемкость-напряжение для МДП конденсатора с электродом из полупроводника *p*-типа. Показано, что зависимость фотоемкостной чувствительности от напряжения смещения имеет вид относительно узкого пика, величина и положение которого на оси напряжений зависит от концентрации донорной примеси. Представлены емкостные и фотоемкостные характеристики для МДП конденсатора с электродом из кремния, легированного индием.

## Введение

Фотоемкостный эффект (ФЕЭ) в металл-диэлектрикполупроводник (МДП) конденсаторах наблюдался в ряде работ [1–8] при фотовозбуждении в собственной полосе поглощения полупроводника и при достаточно высоких температурах, при которых легирующие примесные атомы практически полностью ионизированы. При этих условиях изменение емкости МДП конденсатора возникает в основном вследствие изменения концентрации носителей заряда обоих знаков, т. е. в биполярном режиме.

При фотовозбуждении в примесной полосе поглощения ФЕЭ в МДП конденсаторе может возникать при низкой температуре в результате изменения концентраций ионизированных атомов примеси и свободных носителей заряда одного знака, т.е. в монополярном режиме.

В настоящей работе теоретически исследован ФЕЭ в монополярном МДП конденсаторе при низких температурах, при которых легирующие примесные атомы находятся в основном в неионизированном состоянии, и при напряжениях смещения на барьере порядка потенциала ионизации примесных атомов, т.е. вблизи режима плоских зон. Рассмотрена зависимость емкости и фотоемкостной чувствительности МДП конденсатора от величины и знака напряжения смещения концентрации компенсирующей примеси и температуры.

### Вычисление емкости МДП конденсатора

Рассмотрим одномерную модель МДП конденсатора, у которого одним из электродов является примесный полупроводник с монополярной проводимостью (рис. 1). Напряжение, приложенное к структуре, индуцирует в полупроводнике заряд  $Q(\varphi_0)$  приходящийся на единицу площади конденсатора. При этом поверхность полупроводника приобретает потенциал  $\varphi_0$ . Предполагается, что на границе диэлектрика с полупроводником поверхностные заряды отсутствуют. Индуцированный в полупровод-

нике заряд связан с потенциалом  $\varphi_0$  соотношением

$$Q^{2}(\varphi_{0}) = \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{\varphi_{0}}^{0} \rho(\varphi) d\varphi, \qquad (1)$$

где  $\rho(\varphi)$  — плотность пространственного заряда [9].

По определению, дифференциальная стационарная барьерная емкость в полупроводнике

$$C_b = -\frac{dQ(\varphi_0)}{d\varphi_0}.$$
 (2)

Дифференцируя уравнение (1) и подставляя в (2), получим общее определение барьерной емкости

$$C_b = \frac{\varepsilon}{4\pi} \frac{\rho(\varphi_0)}{Q(\varphi_0)}.$$
(3)

Воспользуемся соотношением (1)-(3) для вычисления барьерной емкости в полупроводнике *p*-типа, легированного акцепторной примесью с энергией ионизации  $E_i$  и частично компенсированного донорной примесью с мелким энергетическим уровнем. Будем полагать, что



**Рис. 1.** Схема МДП конденсатора. V — напряжение смещения,  $\varphi_0$  — потенциал поверхности полупроводника,  $Q(\varphi_0)$  — индуцированных заряд в полупроводнике. I — диэлектрик, 2 — полупроводник.



Рис. 2. Схема энергетических уровней и дырочных переходов.

концентрация неосновных носителей заряда — электронов пренебрежимо мала по сравнению с концентрацией дырок. Пусть  $N_a$  и  $N_d$  — концентрация акцепторов и доноров соответственно. Примем далее, что примеси распределены в среднем равномерно.

Схема энергетических уровней и дырочных переходов изображена на рис. 2. Здесь c — коэффициент захвата дырки ионом индия, q — сечение фотоионизации атома индия,  $\phi$  — плотность потока фотонов,  $p_1 = (N_v/g) \exp(-E_i/kT)$  — шокли-ридовская концентрация, g — фактор вырождения акцепторной примеси.

В отсутствие электрического поля концентрации дырок p, ионизированных акцепторов  $N_a^-$  и нейтральных атомов  $N_a^0$  в стационарном режиме при заданной температуре и интенсивности излучения определяются системой уравнений:

$$cp_1 N_a^0 + q\phi N_a^0 = cp N_a^-,$$
  
 $p + N_d = N_a^-,$   
 $N_a^0 + N_a^- = N_a$  (4)

и выражаются формулами

$$p = \frac{1}{2} \left( (N_d + p_1^*)^2 + 4(N_a - N_d)p_1^* \right)^{1/2} - (N_d + p_1^*), \quad (5)$$
$$N_a^- = N_a p_1^* / (p_1^* + p), \qquad N_a^0 = N_a p / (p_1^* + p), \quad (6)$$

где  $p_a^* = p_1 + q\phi/c$ .

При наличии электрического поля в полупроводнике возникает пространственный заряд плотностью

$$\rho(\varphi) = e \left[ p(\varphi) + N_d - N_a^-(\varphi) \right]. \tag{7}$$

Примем, что концентрация дырок p в точке с потенциалом  $\varphi$  определяется соотношением Больцмана

$$p(\varphi) = p_0 \exp(-\alpha \varphi),$$
 (8)

где  $p_0$  — концентрация дырок при  $\varphi = 0$ ,  $\alpha = e/kT$ . Тогда плотность пространственного заряда

$$\rho(\varphi_0) = e \left[ p_0 \exp(-\alpha \varphi_0) + N_d - N_a \frac{p_1^*}{p_1^* + p_0 \exp(-\alpha \varphi_0)} \right].$$
(9)

4\* Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 5

Подставляя  $\rho(\varphi_0)$  в уравнение (1) и интегрируя, получим для индуцированного заряда выражение

$$Q^{2}(\varphi_{0}) = \frac{\varepsilon kT}{2\pi} \left[ N_{a} \ln \frac{p_{1}^{*} + p_{0} \exp(-\alpha\varphi_{0})}{p_{1}^{*} + p_{0}} + (N_{a} + N_{d})\alpha\varphi_{0} + p_{0} \exp(-\alpha\varphi_{0}) - p_{0} \right].$$
(10)

Далее, подставляя  $\rho(\varphi_0)$  и  $Q(\varphi_0)$  в (3), получим аналитическое выражение для барьерной емкости  $C_b(\varphi_0)$  и ее зависимости от потенциала  $\varphi_0$ , температуры T и интенсивности фотовозбуждения  $\phi$ .

Однако емкость конденсатора  $C_c$  образована последовательным соединением емкости диэлектрического слоя  $C_d$  и барьерной емкости  $C_b$ , так что

$$C_c = \frac{C_d C_b}{C_d + C_b}.$$
 (11)

При этом напряжение, приложенное к конденсатору, является суммой напряжений на диэлектрическом слое  $U_d$  и напряжения на барьере  $\varphi_0$ :

$$V = U_d + \varphi_0, \tag{12}$$

где  $U_d = Q(\varphi_0)/C_d$ . Выражения (11) и (12) составляют параметрическое представление зависимости емкости  $C_c$ от напряжения смещения V с параметром  $\varphi_0$ . Здесь предполагается, что  $C_d$  не зависит от  $U_d$ , температуры и излучения.

#### Фотоемкостной эффект

Определим фотоемкостной эффект как отношение изменения емкости конденсатора  $dC_c$  к изменению интенсивности излучения dI, вызывающего ионизацию примесных атомов

$$S_c = \frac{dC_c}{dI} = \frac{dC_c}{d\phi} \cdot \frac{d\phi}{dI} = \frac{1}{h\nu} \cdot \frac{dC_c}{d\phi}, \qquad (13)$$

где  $I = h\nu\phi$  — интенсивность излучения. Учитывая (11), для фотоемкостной чувствительности при постоянном напряжении получим

$$S_{c} = \frac{1}{h\nu} \frac{C_{d}^{2}}{(C_{d} + C_{b})^{2}} \frac{dC_{b}}{d\phi},$$
(14)

гле

$$\frac{dC_b}{d\phi} = \frac{\varepsilon}{4\pi} \frac{\rho}{Q} \left( \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{d\phi} - \frac{1}{Q} \frac{dQ}{d\phi} \right).$$
(15)

Более детальные формулы, упрощающие вычисления, приведены в Приложении.

Численные расчеты емкостных и фотоемкостных характеристик были выполнены для МДП конденсатора с электродом из кремния, легированного индием и частично компенсированного донорной примесью с мелким энергетическим уровнем. Для вычислений были приняты следующие параметры. Емкость диэлектрического слоя  $C_d = 100 \,\mathrm{H}\Phi/\mathrm{cm}^2$ , что соответствует толщине слоя SiO<sub>2</sub> примерно 35 нм. Концентрация индия  $N_a = 1 \cdot 10^{16} \,\mathrm{cm}^{-3}$ . Энергия ионизации атома индия в кремнии  $E_1 = 160 \,\mathrm{msB}$ . Коэффициент захвата дырки ионом индия  $c = 2.5 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{cm}^3/\mathrm{c}$ , сечение фотоионизации атома индия в кремнии излучением с  $\lambda = 4 \,\mathrm{mkm}$   $q = 5 \cdot 10^{-16} \,\mathrm{cm}^2$ . Фактор вырождения акцепторного уровня индия g = 6.

Далее варьировались: концентрация компенсирующей примеси  $N_d$ , температура T и интенсивность излучения I.

## Обсуждение

C-V-характеристики в отсутствие фотовозбуждения. Семейство C-V-характеристик, вычисленных для T = 70 К и разных значений концентрации компенсирующей примеси  $N_d$  в качестве параметра, представлены на рис. 3. Здесь можно отметить несколько особенностей.

а. Наличие максимума  $C_c$ , величина которого почти не зависит от  $N_d$ . При уменьшении  $N_d$  положение максимума на оси напряжений смещается в сторону положительных (обедняющих) напряжений. В частности, при  $N_d = N_a/2$  максимум располагается при  $V = \varphi_0 = 0$ . При дальнейшем уменьшении  $N_d$  максимум  $C_c$  смещается в область положительных напряжений. В этом случае с увеличением положительного напряжения вначале емкость увеличивается, достигает максимума и только затем уменьшается. При  $\varphi_0 > \varphi_{max} C - V$ -характеристика становится аналогичной C - V-характеристике барьера Шоттки при обратных напряжениях.

При заданной температуре максимальная величина емкости  $C_{c \max}$  слабо зависит от концентрации компенсирующей примеси. Поэтому величину  $C_{c \max}$  можно оценить по величине  $C_{c \max}$  при  $N_d = N_a/2$ . Так как в этом случае максимум емкости располагается при  $V = \varphi_0 = 0$ ,



Рис. 3. C-V-характеристики МДП конденсатора для  $N_d = 9 \cdot 10^{15} (1), 5 \cdot 10^{15} (2), 1 \cdot 10^{15} (3), 1 \cdot 10^{14} (4), 0.0 (5) \text{ см}^{-3}.$   $N_a = 1 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}.$  T = 70 K.

барьерная емкость  $C_b$  определяется дебаевской длиной экранирования  $L_{db}$ . При низкой температуре, при которой  $p_1 \ll N_d$  длина экранирования

$$L_{db}^2 = \frac{\varepsilon kT}{4\pi e^2} \frac{N}{N_d (N_a - N_d)}.$$
 (16)

Поэтому при  $N_d = N_a/2$  получим  $L_{db}^2 = \varepsilon kT/\pi e^2 N_a$  и соответственно

$$C_{b\max} = \frac{\varepsilon}{4\pi L_{db}} = \frac{1}{4} \left(\frac{\varepsilon e^2 N_a}{\pi kT}\right)^{1/2}.$$
 (17)

Подставляя  $C_{c \max}$  при V = 0 и  $C_d$  в (11), получим величину  $C_{b \max}$ . Из этого следует, что по известным величинам  $C_{c \max}$  и  $C_d$  может быть оценена концентрация основной легирующей примеси независимо от концентрации  $N_d$ .

б. Наличие относительно широкого минимума  $C_c$  при отрицательном (обогащающем) напряжении смещения. Значение  $C_c$  в минимуме и положение минимума емкости на оси напряжений зависит от концентрации  $N_d$ . С уменьшением  $N_d$  минимум  $C_c$  углубляется и смещается в сторону положительных значений напряжения. В частности, при  $N_d = 0$  минимум располагается точно при  $V = \varphi_0 = 0$ . При  $N_d > 0$  с увеличением отрицательного напряжения сначала емкость уменьшается, достигает минимума и затем резко увеличенной емкостью диэлектрического слоя.

В области напряжений, где емкость достигает минимума, плотность пространственного заряда определяется в основном концентрацией компенсирующей примеси.

*C*–*V*-характеристики при фотовозбуждении. На рис. 4 и 5 изображены семейства *C*–*V*-характеристик при фотовозбуждении излучением разной интенсивности, вычисленные для двух наиболее характерных значений концентрации компенсирующей примеси  $N_d = 0$  и  $N_d = 1 \cdot 10^{14}$  см<sup>-3</sup> и T = 60 K.

На рис. 4 можно видеть, что при  $N_d = 1 \cdot 10^{14} \,\mathrm{cm^{-3}}$ с увеличением интенсивности излучения *I* левая ветвь C-V-характеристики смещается в сторону положительных напряжений, так что излучение заданной интенсивности вызывает увеличение емкости в относительно узком интервале напряжений смещения. В то же время в правой ветви C-V-характеристики, т.е. при положительном напряжении смещения, влияние излучения на емкость отсутствует, так как при заданной концентрации  $N_d$  в этой области напряжений  $N_a^0 \ll N_a$ .

На рис. 5, где изображено аналогичное семейство C-V-характеристик для  $N_d = 0$ , видно, что излучение вызывает изменение скорости  $C_c$  во всем рассмотренном интервале изменения напряжения. При  $V < V_{\text{max}}$  и соответственно при  $\varphi_0 < \varphi_{\text{max}}$  увеличение интенсивности фотовозбуждения вызывает увеличение емкости  $C_c$ , тогда как при  $V > V_{\text{max}}$  и  $\varphi_0 > \varphi_{\text{max}}$  увеличение *I* вызывает уменьшение емкости. Это обусловлено тем, что при



Рис. 4. C-V-характеристики для  $N_d = 1 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$  и I = 0 (1),  $1 \cdot 10^{-2}$  (2),  $1 \cdot 10^{-1}$  (3) Вт/см<sup>2</sup>.  $N_a = 1 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . T = 60 K.



Рис. 5. C-V-характеристики для  $N_d = 0$  и I = 0 (I),  $1 \cdot 10^{-3}$  (2),  $1 \cdot 10^{-1}$  (3) Вт/см<sup>2</sup>.  $N_a = 1 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>. T = 60 К.

положительном напряжении, при котором  $\varphi_0 > \varphi_{\text{max}}$ , примесные атомы  $N_a$  в барьере практически полностью ионизированы. Поэтому излучение вызывет ионизацию нейтральных атомов  $N_a^0$  за пределами барьерного слоя, что и приводит к расширению барьера и уменьшению емкости конденсатора.

Фотоемкостная чувствительность. Зависимость фотоемкостной чувствительности  $S_c$  от напряжения смещения, вычисленные для разных значений  $N_d$  и температуры T = 70 K, показаны на рис. 6. Здесь можно выидеть, что фотоемкостная чувствительность проявляется в виде относительно острого пика, положение которого на оси напряжений зависит от концентрации компенсирующей примеси. Максимальная величина  $S_c$  проявляется в области значений  $N_d = (1 \cdot 10^{13} - 1 \cdot 10^{14})$  см<sup>-3</sup>. При дальнейшем уменьшении  $N_d$  максимум  $S_c$  при отрицательных напряжениях уменьшается и появляется максимум



Рис. 6.  $S_c - V$ -характеристики МДП конденсатора для  $N_d = 9 \cdot 10^{15} (I), 5 \cdot 10^{15} (2), 1 \cdot 10^{15} (3), 1 \cdot 10^{14} (4), 1 \cdot 10^{12} (5), 0 (6) см^{-3}. N_a = 1 \cdot 10^{16} см^{-3}. T = 60$  К.

 $S_c$  при относительно небольшом положительном напряжении. При этом в случае  $N_d = 0$  величина  $S_c$  при положительном напряжении практически равна максимальной величине  $S_c$  при отрицательных напряжениях. Кривые зависимости  $S_c$  от напряжения смещения имеют резко несимметричный вид. Медленное понижение левой ветви кривой обусловлено влиянием падения части напряжения на диэлектрическом слое.

#### Заключение

Выведены аналитические выражения для емкости и фотоемкостной чувствительности монополярного МДП конденсатора с электродом из полупроводника, легированного акцепторной примесью с глубоким энергетическим уровнем. Показано, что С-V-характеристики монополярного МДП конденсатора при низких температурах, при которых примесные атомы в полупроводниковом электроде слабо ионизированы, приобретают немонотонный характер. Так при низкой степени компенсации донорной примесью *K* « 1 возникает максимум емкости при обедняющих напряжениях смещения. Тогда как при высокой степени компенсации  $1 - K \ll 1$  возникает минимум емкости при обогащающих напряжениях. Показано, что фотоемкостная чувствительность монополярного конденсатора при низких температурах проявляется в виде относительно острого пика, величина и положение которого на оси напряжения смещения зависят от концентрации компенсирующей примеси. Приведены емкостные и фотоемкостные характеристики для МДП конденсатора с электродом из кремния, легированного инлием.

Монополярный МДП конденсатор с электродом из кремния, легированного индием, может быть использован как фотодетектор модулированного инфракрасного излучения, чувствительный в ограниченной области изменения напряжения смещения ("селективность" по напряжению смещения).

Работа выполнена при поддержке Российских научнотехнических программ "Физика твердотельных наноструктур" (проект № 97-1050) и "Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники", а также РФФИ (№ 99-02-16675).

## Приложение

Вычисление фотоемкостной чувствительности МДП конденсатора. С целью упрощения вычислений *S<sub>c</sub>* преобразуем формулу (15). Для этого введем обозначения

$$F_1 = p_0 \exp(-\alpha\varphi) + N_d - N_a \frac{p_1^*}{p_1^* + p_0 \exp(-\alpha\varphi)},$$
  

$$F_2 = N_a \ln \frac{p_1^* + p_0 \exp(-\alpha\varphi)}{p_1^* + p_0} + (N_a - N_d)\alpha\varphi + p_0[\exp(-\alpha\varphi) - 1].$$

Тогда

$$\rho(\varphi) = eF_1, \qquad Q^2(\varphi) = \frac{\varepsilon \kappa I}{2\pi}F_2.$$

В этих обозначениях

$$C_b = e\left(rac{arepsilon}{8\pi kT}
ight)^{rac{1}{2}}rac{F_1}{\sqrt{F_2}},$$
 $rac{dC_b}{d\phi} = rac{C_b}{2}\left(2rac{1}{F_1}rac{dF_1}{d\phi} - rac{1}{F_1}rac{dF_2}{d\phi}
ight),$ 

где

$$\begin{split} \frac{dF_1}{d\phi} &= \frac{q}{c} \exp(-\alpha \varphi) \left[ S_p - N_a \frac{p_0 - p_1^* S_p}{[p_1^* + p_0 \exp(-\alpha \varphi)]^2} \right], \\ \frac{dF_2}{d\phi} &= \frac{q}{c} \left[ \exp(-\alpha \phi) - 1 \right] \\ &\times \left[ S_p - N_a \frac{p_0 - p_1^* S_p}{[p_1^* + p_0 \exp(-\alpha \varphi)](p_1^* + p_0)} \right], \\ S_p &= \frac{N_a - N_d - p_0}{2p_0 + N_d + p_1^*}. \end{split}$$

#### Список литературы

- [1] R.F. Pierret, S.T. Sah. Sol. St. Electr., 13, 269, 289 (1970).
- [2] A.V. Sachenko, V.A. Zuev, V.G. Litovchenko, P. Peikov. Phys. St. Sol. (a), 21, 345 (1974).
- [3] Н.Ф. Ковтонюк. ФТП, 9, 2386 (1975).
- [4] В.Г. Литовченко, А.П. Горбань. Основы физики микроэлектронных систем металл-диэлектрик-полупроводник (Киев, Наук. думка, 1978) гл. 6. с. 167.
- [5] A. Sher, Y.H. Tsuo, John A. Moriatry, W.E. Miller, R.K. Grouch. J. Appl. Phys., 51, 2137 (1980).
- [6] А.А. Лебедев, Н.А. Соболев, В. Экке. ФТП, 15, 1438 (1981).

- [7] В.А. Зуев, В.Г. Попов. Фотоэлектриеские МДП приборы (М., Радио и связь, 1983) гл. 4, с. 89.
- [8] Н.Ф. Ковтонюк, Е.Н. Сальников. Фоточувствительные МДП приборы для преобразования изображений (М., Радио и связь, 1990) гл. 1, с. 8.
- [9] Н.А. Пенин. ФТП, 17, 431 (1983).

Редактор В.В. Чалдышев

## Photocapacitance effect in monopolar metal-insulator-semiconductor capacitor at low temperatures

N.A. Penin

P.N. Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, 117924 Moscow, Russia

**Abstract** The photocapacitance effect in a monopolar MIS capacitor arising due to optical ionization of impurity atoms at low temperatures has been studied theoretically. Analytic expressions were derived for capacitance-voltage and photocapacitance-voltage characteristics of a MIS capacitor with a *p*-type semiconductor electrode. It is shown that the photocapacitance response dependence on the bias voltage has a relatively narrow peak. The peak amplitude and its position on the bias voltage axis depends on the donor impurity concentration. Calculated capacitance and photocapacitance characteristics are presented for a MIS capacitor with an indium doped silicon electrode.